

물 품 사 양 서

COMMODITY DESCRIPTION

1. 품명	펄스레이저증착 용 진공 챔버 PLD Chamber		
2. 수량	1 set	3. 작성일	2021. 04. 21
4. 세부사양 (Specifications)			
<p>펄스레이저증착 시스템 (Pulsed Laser Deposition System)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 본 제품은 메인 챔버, 펌핑 모듈, 진공 게이지 모듈, 히팅 모듈, 타겟 캐로셀 모듈을 포함하는 진공챔버 및 레이저 제어 시스템임. - 메인 챔버: SUS304 재질, $\varnothing 320*380H$, 실린더 타입의 진공용 챔버 - 다수의 포트를 제공하며 $5 \times 10^{-10} \text{Torr}$ 이하 고진공에 적합 - 펌핑모듈 <ul style="list-style-type: none"> * 700 L/s Peiffer Vacuum 사 터보분자펌프 * 600 L/min 로터리 펌프 * NW25 angle valve, Rotary Vent valve, CF8" Gate Valve - 히팅모듈 <ul style="list-style-type: none"> * 최대 1200°C 지원 2" PBN 히터 * UHV CF2.75" Z축 Manipulator 및 rotary motion 등 포함 - 타겟 캐로셀 모듈 <ul style="list-style-type: none"> * 1" 타겟 홀더, 4채널 * 스텝모터 기반 타겟 위치 제어기 - 진공 게이지 모듈 <ul style="list-style-type: none"> * 게이지 컨트롤러, 저진공 게이지, 고진공 게이지, Baratron 게이지 포함 - 뷰포트(CF 8", CF4.5") 및 엑시머레이저용 윈도우 (CF4.5") - 엑시머레이저 제어 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> * 레이저 원격제어, 타겟 캐로셀 위치(공전) 선택, 타겟 자전 원격제어 * 레이저 펄스, 에너지 프로그래밍 기능 지원 			
Remarks			
(1) Warranty	1 year		